

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成18年4月6日(2006.4.6)

【公表番号】特表2002-509783(P2002-509783A)

【公表日】平成14年4月2日(2002.4.2)

【出願番号】特願2000-540910(P2000-540910)

【国際特許分類】

B 0 1 D 24/46 (2006.01)

B 0 1 D 33/44 (2006.01)

B 0 1 D 33/58 (2006.01)

【F I】

B 0 1 D 33/36

【手続補正書】

【提出日】平成18年2月15日(2006.2.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 フィルタ空間に、加圧空間で行われる濾過へ被処理物質を供給する部材と、濾過生成物すなわち濾過残滓を加圧フィルタ空間から除去する部材とが設置されている、加圧フィルタ空間からの濾過残滓除去装置において、前記フィルタ空間の排出導管の残滓排出端部には、調節部材が連結され、該調節部材は少なくとも2つの調節要素を含み、該要素は、互いに対して同心状に設置され、出入口を備えていて、互いに対して移動可能であり、前記排出導管に含まれる濾過残滓の測定可能な表面高さを、実質的に所定の値に実質的に継続的に維持することを特徴とする濾過残滓除去装置。

【請求項2】 請求項1に記載の装置において、前記調整要素の少なくとも一方は、軸の周りを回動可能に設置されていることを特徴とする濾過残滓除去装置。

【請求項3】 請求項1または2に記載の装置において、前記濾過残滓の表面高さを測定するため、前記排出導管には超音波センサが設けられていることを特徴とする濾過残滓除去装置。

【請求項4】 請求項1または2に記載の装置において、前記濾過残滓の表面高さを測定するため、前記排出導管には該排出導管の支持構体における変化を測定するアクチュエータが設置されていることを特徴とする濾過残滓除去装置。

【請求項5】 請求項4に記載の装置において、前記排出導管の支持構体の変化を測定するアクチュエータは力測定センサであることを特徴とする濾過残滓除去装置。

【請求項6】 請求項4に記載の装置において、前記排出導管の支持構体の変化を測定するアクチュエータは、張力測定センサであることを特徴とする濾過残滓除去装置。

【請求項7】 請求項1ないし6のいずれかに記載の装置において、前記濾過残滓の表面高さの測定手段と、前記調節要素を動かす部材とは、電氣的に相互連結されていることを特徴とする濾過残滓除去装置。